

機器名	マスクアライメント装置、露光装置	
メーカー名・型番	ミカサ M-2L	
分類	半導体関連、光関連	
仕様	ガラス、光学結晶、セラミックス基板等の大型試料のフォトリソグラフィ工程において、ガラスマスクと基板の目合わせを行いフォトレジストの露光焼付けを行う装置	
特徴	左右成立像の双対物型双眼顕微鏡で数ミクロンの軸合わせが可能	